

第1回 先端機器研究会セミナー

新技術：質量分析装置におけるコールドスプレーイオン源
--エレクトロスプレーイオン源との比較から--

日本電子株式会社 応用研究センター

小沼 純貴氏

主催
日時
会場

先導物質化学研究所 研究支援センター
2004年5月17日 16:30-17:30
先導研南棟112号室

連絡先 研究支援センター 出田圭子
内線 (春日 93-) 8898
keiko@cm.kyushu-u.ac.jp